

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 21 年 7 月 23 日 (2009.7.23)

【公開番号】特開 2007-287643 (P2007-287643A)

【公開日】平成 19 年 11 月 1 日 (2007.11.1)

【年通号数】公開・登録公報 2007-042

【出願番号】特願 2006-160780 (P2006-160780)

【国際特許分類】

H 0 5 G 1/00 (2006.01)

H 0 1 J 35/06 (2006.01)

H 0 1 J 35/10 (2006.01)

H 0 5 G 1/52 (2006.01)

【F I】

H 0 5 G 1/00 G

H 0 1 J 35/06 B

H 0 1 J 35/10 C

H 0 1 J 35/10 H

H 0 5 G 1/52 A

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 6 月 8 日 (2009.6.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ターゲットの表面に所定のエネルギー線源からエネルギー線を照射し、被写体に対する照射面積とほぼ同一の大きさとなるように前記ターゲットから X 線を発生させる工程と、

前記 X 線を分光器に入射させ、前記 X 線から波長及び波長幅を選択されるとともに、平行光となった平行 X 線を生成する工程と、  
を具えることを特徴とする、X 線発生方法。

【請求項 2】

前記分光器は結晶板からなることを特徴とする、請求項 1 に記載の X 線発生方法。

【請求項 3】

前記結晶板は、水晶、グラファイト、ゲルマニウム及びシリコンからなる群より選ばれる材料からなる結晶板であることを特徴とする、請求項 2 に記載の X 線発生方法。

【請求項 4】

前記結晶板を 2 以上組み合わせて用いることを特徴とする、請求項 2 又は 3 に記載の X 線発生方法。

【請求項 5】

前記分光器は X 線用多層膜反射板であることを特徴とする、請求項 1 に記載の X 線発生方法。

【請求項 6】

エネルギー線照射により X 線を発生させるためのターゲットと、

前記 X 線が被写体に対する照射面積とほぼ同一の大きさとなるように前記エネルギー線を生成し、このエネルギー線を前記ターゲットに対して照射するためのエネルギー線源と

、

前記 X 線を入射させ、前記 X 線から波長及び波長幅を選択するとともに、平行光となった平行 X 線を生成するための分光器と、  
を具備することを特徴とする、X 線発生装置。

【請求項 7】

前記分光器は結晶板からなることを特徴とする、請求項 6 に記載の X 線発生装置。

【請求項 8】

前記結晶板は、水晶、グラファイト、ゲルマニウム及びシリコンからなる群より選ばれる材料からなる結晶板であることを特徴とする、請求項 7 に記載の X 線発生装置。

【請求項 9】

前記結晶板を 2 以上組み合わせて用いることを特徴とする、請求項 7 又は 8 に記載の X 線発生装置。

【請求項 10】

前記分光器は X 線用多層膜反射板であることを特徴とする、請求項 6 に記載の X 線発生装置。